



個別管理

無加湿対応の胚専用培養器です!



Dry Culture System

加湿を必要としない培養法です。一般の胚培養では、インキュベーターチャンバー内に加湿用の水分パットを設置して加湿が行なわれていますが胚培養では、水分が蒸発しないようにメディアをオイルで覆っています。48時間同一培地での培養時の水分蒸発、浸透圧上昇の割合は、市販培地の製品間ロット差に比較すると僅かであり、胚培養に特に問題ありません。

- 温度設定
- ガス濃度設定
- ガス流量モニター



EC6S本体にあるコントローラにより温度、ガス濃度を設定、制御します。また各チャンネルのガス流量を確認することもできます。



ボトムプレートA BP-A@12,000
ファルコン35mmx6、60mmx3、ヌンク4ウェルx2
ボトムプレートB BP-B@12,000
ファルコン35mmx6、センターウェル60mmx3、ヌンク4ウェルx2
ボトムプレートC BP-C@12,000
ヌンク35mmx6、60mmx3、4ウェルx2
特注ボトムプレート制作についてはお問い合わせ下さい。



■ 特長

- ① 上蓋にヒーターが新たに設置され庫内の安定性が更に向上!
- ② 加湿水を必要としないのでカビが発生しない!
- ③ 器内がシンプルな作りの為、清掃メンテナンスが容易!
- ④ 個別管理に最適!
- ⑤ データ収集用ソフトEZC-Loggerが付属!

■ データ収集用ソフト EZC-Logger



画面について 1 警報履歴 2 リアルタイムトレンド 3 ヒストリカルトレンド

(寸法単位=mm)

型 式		EC6S
外形寸法 ※1		W517.5xD608xH171
チャンバー	室数	6
	内形寸法	W108xD180xH18.5/1室
	内容積	300ml (標準底板装着時)/1室
	ボトムプレート	A、B、Cから6枚選択
	流量センサ	各チャンネルに内蔵
温度制御方式		デジタルPID制御、各培養室独立制御
使用環境温度		20°C~30°C
温度制御範囲 ※2		室温+5°C~40°C
温度変動幅 ※2		±0.1°C
CO ₂ センサ		IRセンサ
CO ₂ 制御方式		Duty制御
CO ₂ 制御範囲 ※3		0~20.0%
CO ₂ 変動幅 ※3		±0.3%
O ₂ センサ		セラミック式酸素センサ
O ₂ 制御方式		Duty制御
O ₂ 制御範囲 ※3		0.1~18.0%
O ₂ 変動幅 ※3		±0.5%
供給ガス		CO ₂ ガス、N ₂ ガス
外装		亜鉛メッキ鋼板、静電焼付塗装仕上
内装		アルミニウム
警報		オーバーテンプ・温度センサ・CO ₂ ガス濃度・O ₂ ガス濃度・ガス流量・ポンプの各項目異常時
外部出力	アナログ出力	温度・CO ₂ /O ₂ 濃度・ガス流量
	接点出力	アラーム発生時に CLOSE 停電発生時に CLOSE
製品質量		26kg
電源		AC100V 50/60Hz 1.5A
価格		¥2,200,000

※1:外形寸法は、アジャスターを含む高さです。 ※2:アルミ表面部 ※3:ガス混合用タンク内部

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。